Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, СПИНТРОНИКЕ И ФОТОНИКЕ КАФЕДРА ФИЗИКИ МИКРО- И НАНОСИСТЕМ

ОДОБРЕНО НТС ИНТЭЛ

Протокол № 4

от 23.07.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В КВАНТОВУЮ ЭЛЕКТРОНИКУ

Направление подготовки (специальность)

[1] 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
7	2	72	32	32	0		8	0	3
Итого	2	72	32	32	0	0	8	0	

АННОТАЦИЯ

В курсе изучаются физические принципы получения лазерной генерации и усиления. Излагаются физические механизмы создания и поддержания инверсии населенностей, изучаются энергетические уровни, времена жизни и скорости переходов в лазерных средах. Отдельное внимание уделяется резонаторам и их свойствам, а также нелинейно-оптическому преобразованию в гармоники. Дано описание наиболее часто использующихся типов лазеров. Отдельное внимание обращается на предельные энергетические характеристики лазерных генераторов и усилителей. Излагаются основные сведения об особенностях применения лазерных систем для микрообработки различных материалов.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дать основные физические представления о принципах получения и преобразования лазерного излучения, а также его применении в технологических процессах микрообработки материалов.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина знакомит с основными понятиями квантовой электроники, закономерностями процессов генерации и усиления лазерного излучения, с методами управления его параметрами, а также с конструкцией и принципом действия различных приборов квантовой электроники. Изучение курса позволяет студентам:

- а) освоить основные аспекты применения в области квантовой электроники важнейших разделов квантовой механики и квантовой теории поля, образующих фундамент всех физических воззрений на природу явлений;
- б) уяснить содержание и физический смысл основных экспериментальных достижений в области квантовой электроники, понять границы применимости физических законов в указанной области;
- в) изучить физические основы разработки и функционирования основных типов лазеров и лазерных систем;
- г) ознакомиться с современным состоянием применения приборов квантовой электроники в различных областях науки и техники.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	± ±
Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача	Объект или	Код и наименование	Код и наименование
профессиональной	область знания	профессиональной	индикатора
деятельности (ЗПД)		компетенции;	достижения

		Основание	профессиональной
		(профессиональный	компетенции
		стандарт-ПС, анализ	
		опыта)	
	научно-иссл	<u>педовательский</u>	
математическое	электронные	ПК-10.1 [1] - Способен	3-ПК-10.1[1] - законы
моделирование	приборы,	применять методы и	и экспериментальные
электронных приборов,	устройства,	концепции	методы физики
схем и устройств	установки, методы	экспериментальной	конденсированного
различного	их исследования,	физики	состояния вещества,
функционального	математические	конденсированного	лазерной физики,
назначения на базе	модели	состояния вещества,	физики микро- и
стандартных пакетов		лазерной физики,	наносистем, принципы
автоматизированного		фотоники, физики	функционирования
проектирования;		микро- и наносистем	элементов и устройств
участие в		для решения	фотоники и
планировании и		технических,	оптоэлектроники;
проведении		технологических и	У-ПК-10.1[1] -
экспериментов по		функциональных	анализировать научно-
заданной методике,		проблем при создании	техническую
обработка результатов с применением		и эксплуатации элементов и устройств,	проблему, поставленную задачу в
современных		функционирующих на	области
информационных		принципах	нанофотоники, физики
технологий и		наноэлектроники и	конденсированного
технических средств;		нанофотоники	состояния вещества,
анализ научно-		пинофотоники	физики наноструктур,
технической		Основание:	используя
информации,		Профессиональный	отечественный и
отечественного и		стандарт: 40.011	зарубежный опыт, а
зарубежного опыта по		7.1	также предлагать
тематике			возможные пути ее
исследования; участие			решения;
в подготовке и подаче			В-ПК-10.1[1] -
заявок по			навыками
перспективным			экспериментальной
проектам, грантам в			работы на
рамках проводимых			специализированном
открытых конкурсов			научном
			оборудовании и
			устройствах в области
			фотоники, физики
			наноструктур,
			лазерной физики,
			опто- и
			наноэлектроники,
			математического
			моделирования
			процессов и объектов
			применительно к поставленной задаче
	простисти и		поставленной задаче
	просктно-ко	онструкторский	

контроль соответствия	электронные	ПК-10.4 [1] - Способен	3-ПК-10.4[1] -
разрабатываемых	приборы,	к контролю,	численные значения
проектов и	устройства,	измерению и	основных параметров,
технической	установки	корректировке	характеризующих
документации		параметров	приборы на принципах
стандартам,		экспериментальных	оптоэлектроники,
техническим условиям		образцов приборов	фотоники на основе
и другим нормативным		квантовой	наноструктурных
документам		электроники,	материалов, в т.ч.
		фотоники,	параметры
		оптоэлектроники на	экспериментальных
		основе	(разрабатываемых)
		наноструктурных	образцов;
		материалов и	У-ПК-10.4[1] -
		наносистем	проводить измерения
			и контроль параметров
		Основание:	при исследовании
		Профессиональный	технических
		стандарт: 40.015	характеристик
		•	разрабатываемых
			устройств на
			принципах
			оптоэлектроники,
			фотоники на основе
			наноструктурных
			материалов и
			наносистем;
			В-ПК-10.4[1] -
			навыками
			оптимизации
			параметров
			разрабатываемых
			образцов устройств на
			принципах
			оптоэлектроники,
			фотоники на основе
			наноструктурных
			материалов и
			наносистем
	производственн	о-технологический	1
внедрение результатов	материалы,	ПК-9 [1] - Способен	3-ПК-9[1] - Знание
исследований и	компоненты,	выполнять	параметров
разработок в	электронные	определенный тип	полупроводниковых
производство;	приборы,	измерительных или	приборов аналоговой,
выполнение работ по	устройства,	контрольных операций	цифровой,
технологической	установки, методы	при исследовании	радиочастотной и
подготовке	их исследования,	параметров	СВЧ-электроники.;
производства	проектирования и	полупроводниковых	У-ПК-9[1] - Умение
материалов и изделий	конструирования,	приборов и устройств	выполнять
электронной техники;	технологические	или в технологическом	исследования
проведение	процессы	процессе по	параметров
технологических	производства,	производству	полупроводниковых
<u> </u>	, , ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	T		
процессов	диагностическое и	материалов и изделий	приборов и устройств
производства	технологическое	электронной техники	в микро- и
материалов и изделий	оборудование,		наноэлектронике;
электронной техники;	алгоритмы решения	Основание:	В-ПК-9[1] - Владение
контроль за	типовых задач	Профессиональный	методами измерений в
соблюдением		стандарт: 29.002	технологическом
технологической			процессе по
дисциплины и приемов			производству
энерго - и			материалов и изделий
ресурсосбережения;			электронной техники
подготовка			
документации и			
участие в работе			
системы менеджмента			
качества на			
предприятии;			
организация			
метрологического			
обеспечения			
производства			
материалов и изделий			
электронной техники			

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания		дисциплин
Профессиональное и	Создание условий,	Использование
трудовое воспитание	обеспечивающих, формирование	воспитательного потенциала
	культуры исследовательской и	дисциплин "Основы
	инженерной деятельности (В16)	конструирования и САПР",
		"Курсовой проект: основы
		конструирования и САПР",
		"Инженерная и компьютерная
		графика", "Детали машин и
		основы конструирования" для
		формирования навыков
		владения эвристическими
		методами поиска и выбора
		технических решений в
		условиях неопределенности
		через специальные задания
		(методики ТРИЗ,
		морфологический анализ,
		мозговой штурм и др.),
		культуры инженера-
		разработчика через
		организацию проектной, в том
		числе самостоятельной работы
		обучающихся с
		использованием программных
		пакетов.

	T ==	
воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование ответственности за профессиональный выбор, профессиональное развитие и профессиональные решения (В18)	Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования у студентов ответственности за свое профессиональное развитие посредством выбора студентами индивидуальных образовательных траекторий, организации системы общения между всеми участниками образовательного процесса, в том числе с использованием новых информационных технологий.
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование творческого инженерного/профессионального мышления, навыков организации коллективной проектной деятельности (В22)	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития навыков коммуникации, командной работы и лидерства, творческого инженерного мышления, стремления следовать в профессиональной деятельности нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения, ответственности за принятые решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для: - формирования производственного коллективизма в ходе совместного решения как модельных, так и практических задач, а также путем подкрепление рациональнотехнологических навыков взаимодействия в проектной деятельности эмоциональным эффектом успешного взаимодействия, ощущением роста общей эффективности при распределении проектных

задач в соответствии с
сильными компетентностными
и эмоциональными свойствами
членов проектной группы.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

No	Наименование			, •			
п.п	паименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	7 Семестр						
1	Первый раздел	1-8	16/16/0		25	КИ-8	3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9, 3-ПК-10.1, У-ПК-10.1, В-ПК-10.4, У-ПК-10.4, В-ПК-10.4,
2	Второй раздел	9-16	16/16/0		25	КИ-16	3-ПК-10.1, У-ПК-10.1, В-ПК-10.4, 3-ПК-10.4, У-ПК-10.4, В-ПК-10.4, 3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9
	Итого за 7 Семестр		32/32/0		50		
	Контрольные мероприятия за 7 Семестр				50	3	3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9, 3-ПК-10.1, У-ПК-10.1, В-ПК-10.4, У-ПК-10.4, В-ПК-10.4

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

^{**} – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
3	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,	
		час.	час.	час.	
	7 Семестр	32	32	0	
1-8	Первый раздел	16	16	0	
1 - 2	Тема 1.	Всего а	удиторных	часов	
	Основные понятия. Вероятность переходов в поле	3	3	0	
	теплового излучения. Коэффициенты Эйнштейна.	Онлайі	H		
	Вероятность перехода в монохроматическом поле. Форма	0	0	0	
	и ширина линии перехода. Поперечное время релаксации.				
2 - 3	Тема 2.		удиторных	часов	
	Факторы, определяющие ширину спектральных линий	3	3	0	
	газов. Однородное и неоднородное уширение. Эффект	Онлайі	H		
	насыщения. Полевое уширение. Параметр насыщения.	0	0	0	
4 - 5	Тема 3.	Всего а	удиторных	часов	
	Усиление и чувствительность квантового усилителя.	3	3	0	
	Влияние насыщения. Чувствительность и энергетические	Онлайі	H	•	
	характеристики квантового усилителя. Предельные	0	0	0	
	значения выходной энергии и выходной интенсивности.				
	Амплитудное и фазовое условие генерации. Предельное				
	значение интенсивности генератора.				
5 - 6	Тема 4.	Всего а	аудиторных	часов	
	Спектроскопические характеристики трехвалентного иона	3	3	0	
	хрома и механизм образования инверсии в рубиновом	Онлайн			
	лазере. Стационарная интенсивности, стационарная и	0	0	0	
	пороговая инверсия одномодового рубинового лазера.				
	Переходной режим, временные, энергетические и				
	спектральные характеристики одномодового рубинового				
	лазера				
7 - 8	Тема 5.	Всего аудиторных часов			
	Энергетические характеристики и динамика гигантского	4	4	0	
	импульса. Методы модуляции добротности.	Онлайн			
	Синхронизация мод.	0	0	0	
9-16	Второй раздел	16	16	0	
9 - 10	Тема 6.		удиторных	часов	
	Твердотельные неодимовые лазеры. Лазеры на	3	3	0	
	редкоземельных скандиевых и галлиевых гранатах.	Онлайі	Ŧ		
	Газовые лазеры. СО2 -лазеры. Азотный и эксимерный	0	0	0	
	лазеры. Химические лазеры. Лазеры на красителях.				
	Лазеры на свободных электронах. Полупроводниковые				
	лазеры. Волоконные лазеры.				
10 - 11	Тема 7.	Всего	ц удиторных	часов	

	Характеристики и свойства оптических резонаторов.	3	3	0	
	Добротность резонатора. Продольные и поперечные моды.		<u>т - </u>		
	Устойчивость резонаторов. Конструкции резонаторов.	0	0	0	
	Методы селекции мод.				
11 - 12	Тема 8.	Всего аудиторных часов			
	Нелинейно-оптическое преобразование. Природа	3	3	0	
	нелинейной поляризации и распространение волн в		Онлайн		
	нелинейных средах. Генерация второй гармоники.	0	0	0	
	Параметрическое усиление. Фазовое согласование при				
	параметрическом усилении. Параметрическая генерация.				
	Перестройка частот, выходная мощность и насыщение				
	накачки в оптических параметрических генераторах.				
12 - 13	13 Тема 9.		Всего аудиторных часов		
	Физические основы лазерной микрообработки	2	2	0	
			Онлайн		
		0	0	0	
13 - 14	Тема 10.	Всего аудиторных часов			
	Источники и оптические системы для лазерной	2	2	0	
	микрообработки.	Онлайн			
		0	0	0	
15 - 16	Тема 11.	Всего	аудиторных	х часов	
	Процессы лазерной микрообработки. Разделение	3	3	0	
	материалов, лазерная резка, лазерно-индуцированное	Онлайн			
	травление, лазерная маркировка, скрайбирование,	0	0	0	
	управляемое термораскалывание, сверление				
	микроотверстий.				

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	Темы занятий / Содержание		
	7 Семестр		
1 - 2	Тема 1.		
	Основные понятия. Вероятность переходов в поле теплового излучения.		
	Коэффициенты Эйнштейна. Вероятность перехода в монохроматическом поле. Форма		
	и ширина линии перехода. Поперечное время релаксации.		
2 - 3	Тема 2.		
	Факторы, определяющие ширину спектральных линий газов. Однородное и		
	неоднородное уширение. Эффект насыщения. Полевое уширение. Параметр		

	насыщения.	
4 - 5	Тема 3.	
	Усиление и чувствительность квантового усилителя. Влияние насыщения.	
	Чувствительность и энергетические характеристики квантового усилителя.	
	Предельные значения выходной энергии и выходной интенсивности. Амплитудное и	
	фазовое условие генерации. Предельное значение интенсивности генератора.	
5 - 6	Тема 4.	
	Спектроскопические характеристики трехвалентного иона хрома и механизм	
	образования инверсии в рубиновом лазере. Стационарная интенсивности,	
	стационарная и пороговая инверсия одномодового рубинового лазера. Переходной	
	режим одномодового рубинового лазера. Временные, энергетические и спектральные	
	характеристики одномодового рубинового лазера.	
7 - 8	Тема 5.	
	Энергетические характеристики и динамика гигантского импульса. Методы	
	модуляции добротности. Синхронизация мод.	
9 - 10	Тема 6.	
	Твердотельные неодимовые лазеры. Лазеры на редкоземельных скандиевых и	
	галлиевых гранатах. Газовые лазеры. СО2 -лазеры. Азотный и эксимерный лазеры.	
	Химические лазеры. Лазеры на красителях. Лазеры на свободных электронах.	
	Полупроводниковые лазеры. Волоконные лазеры.	
10 - 11	Тема 7.	
	Характеристики и свойства оптических резонаторов. Добротность резонатора.	
	Продольны еи поперечные моды. Устойчивость резонаторов. Конструкции	
11 10	резонаторов. Методы селекции мод.	
11 - 12	Тема 8.	
	Нелинейно-оптическое преобразование. Природа нелинейной поляризации и	
	распространение волн в нелинейных средах. Генерация второй гармоники.	
	Параметрическое усиление. Фазовое согласование при параметрическом усилении.	
	Параметрическая генерация. Перестройка частот, выходная мощность и насыщение	
12 - 13	накачки в оптических параметрических генераторах. Тема 9.	
12 - 13		
13 - 14	Физические основы лазерной микрообработки. Тема 10.	
13 - 14	Источники и оптические системы для лазерной микрообработки.	
15 - 16	Тема 11.	
15 10	Процессы лазерной микрообработки. Разделение материалов, лазерная резка, лазерно-	
	индуцированное травление, лазерная маркировка, скрайбирование, управляемое	
	термораскалывание, сверление микроотверстий.	
	1 - Principal American America	

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При проведении лекций используются наглядные формы демонстрации учебного материала в виде презентаций, а также выступление ученых-исследователей, занимающихся исследованиями в области лазерной физики, фотоники, нанофотоники, наноэлектроники и практических применений. Проведение семинаров предусматривает проведение дискуссий и выступления студентов с докладами на темы, связанные с применением лазеров в аналитических методах.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие
		(KII 1)
ПК-10.1	3-ПК-10.1	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-10.1	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-10.1	3, КИ-8, КИ-16
ПК-10.4	3-ПК-10.4	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-10.4	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-10.4	3, КИ-8, КИ-16
ПК-9	3-ПК-9	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-9	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-9	3, КИ-8, КИ-16

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению	
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины	
		если он глубоко и прочно усвоил	Оценка «отлично» выставляется студенту,	
			программный материал, исчерпывающе,	
90-100	5 – «отлично»	A	последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно	
70-100	5 - "OmitiqHo"	A		
			стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. Оценка «удовлетворительно»	
85-89		В		
75-84	4 – «хорошо»	С		
70-74		D	существенных неточностей в ответе на	
		D		
65-69			Оценка «удовлетворительно»	
			выставляется студенту, если он имеет	
			знания только основного материала, но не	
	3 –		усвоил его деталей, допускает неточности,	
60-64	«удовлетворительно»	E	недостаточно правильные формулировки,	
			нарушения логической	
			последовательности в изложении	
			программного материала.	
	2 –		Оценка «неудовлетворительно»	
Ниже 60	«неудовлетворительно»	F	выставляется студенту, который не знает	
	«пеуоовлетворительно»		значительной части программного	

материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится
студентам, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 535 С16 Оптика и фотоника. Принципы и применения Т.1 , Салех Б., Долгопрудный: Интеллект, 2012
- 2. 535 С16 Оптика и фотоника. Принципы и применения Т.2 , Салех Б., Долгопрудный: Интеллект, 2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Демонстрационный проектор (Э-207)

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Обучающийся, для успешного освоения данного курса, должен знать:

- высшую математику в соответствии с основными разделами курса высшей математики в университетском объеме;
- разделы курса теоретической физики в части квантовой механики, статистической физики;
 - курс общей физики (часть оптика);
 - курс физической оптики и основ фотоники,

При выполнении практических заданий допускается использование студентами справочных материалов, необходимых для проведения численных расчетов. Допускается использование интернет-ресурсов при работе над заданиями.

Ответы на вопросы для текущего контроля должны показывать уверенное владение материалом из соответствующей темы.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

При изложении материала необходимо особое внимание уделить вводным разделам, объясняющим физические механизмы получения лазерной генерации и усиления. Лекции должны сопровождаться наглядным иллюстративным материалом, в частности, с использованием компьютерных технологий. Следует уделить особое внимание практическим расчетам, выполняемым самими студентами при работе над текущими заданиями. Допускается использование студентами справочных материалов, необходимых для проведения численных расчетов. Формулировку практических заданий следует выполнять подробно, а так же допускать использование интернет-ресурсов при работе над заданиям

Автор(ы):

Котковский Геннадий Евгеньевич, к.ф.-м.н.